BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-129970

(43)Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 07-308357

(71)Applicant: NE

NEC CORP

(22)Date of filing:

31.10.1995

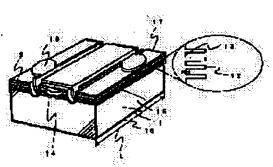
(72)Inventor:

FURUSHIMA YUJI

(54) LASER DIODE ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser diode element having an excellent light outputting characteristic and an excellent modulating characteristic over a wide temperature range by providing an active layer composed of an InGaAsP multi-strain quantum well and specifying the resonator length, detuning amount at a room temperature, and number of quantum wells or the light confining coefficient into a quantum well layer. SOLUTION: After an active layer composed of an InGaAsP strain quantum well layer 12 and a barrier layer 13 is formed on an n-type InP substrate 11, a DC-PBH current constricting structure 14 and a . /4-shifting diffraction grating 15 are formed on the active layer. In addition, an n-side electrode 16 is formed on the rear surface and a nonreflective coating 17 and a pside pad electrode 18 are formed on the front surface. The resonator length, detuning amount at a room temperature, and number of quantum layers or the light confining efficient into a quantum well layer are respectively set at 300-600. m, -15nm to +15nm, and 8-15 layers or 3-10%. The preferable resonator length, detuning amount, number of quantum wells or the light confining coefficient are 400-500, m, -10 to +10nm, and 10-12 layers or 5-8%, respectively.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.10.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

28.03.2000

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-129970

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

H01S 3/18

審査請求 有 請求項の数4 FD (全 13 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平7-308357

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

平成7年(1995)10月31日

(72)発明者 古嶋 裕司

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

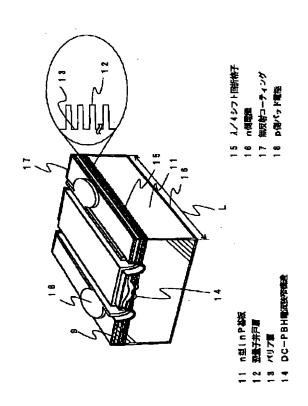
(74)代理人 弁理士 鈴木 章夫

(54) 【発明の名称】 レーザダイオード素子

(57)【要約】

【課題】 伝送速度数百Mb/s以上、伝送距離数十K m以上の長距離高速光通信システム用の光源としてレー ザダイオード素子を構成する場合、広い温度範囲 (-4 0~+85℃) で良好な光出力特性ならびに変調特性を 得ることが困難になる。

【解決手段】 1.3 μm帯λ/4シフト分布帰還型の レーザダイオードにおいて、InGaAsP歪多重量子 井戸からなる活性層を有し、共振器長300~600μ m、かつ、室温での離調量-15~+15nmで、量子 井戸数8~15層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係 数が3~10%となるように素子を構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 In GaAs P歪多重量子井戸からなる活性層を有し、共振器長300~600 μ m、かつ、室温での離調量-15~+15nmで、量子井戸数8~15層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が3~10%であることを特徴とする1.3 μ m帯 $\lambda/4$ シフト分布帰還型のレーザダイオード素子。

【請求項2】 In GaAs P歪多重量子井戸からなる活性層を有し、共振器長 $400\sim500\mu$ m、かつ、室温での離調量 $-10\sim+10$ nmで、量子井戸数 $10\sim12$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $5\sim8$ %であることを特徴とする 1.3μ m帯 $\lambda/4$ シフト分布帰還型のレーザダイオード素子。

【請求項3】 AlGaInAs 歪多重量子井戸からなる活性層を有し、共振器長 $250\sim600\mu$ m、かつ、室温での離調量 $-20\sim+15$ nmで、量子井戸数 $5\sim15$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $2\sim10\%$ であることを特徴とする1.3 μ m帯 $\lambda/4$ シフト分布帰還型のレーザダイオード素子。

【請求項4】 A1GaInAs 歪多重量子井戸からなる活性層を有し、共振器長 $300\sim500\mu$ m、且つ、室温での離調量 $-15\sim+10$ nmで、量子井戸数 $6\sim12$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $2.5\sim8$ %であることを特徴とする 1.3μ m帯 $\lambda/4$ シフト分布帰還型のレーザダイオード素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光通信システムの光源として用いられる半導体素子に関し、特に広い温度範囲で良好な光出力特性ならびに変調特性を有するレーザダイオード素子に関する。

[0002]

【従来の技術】光通信システムの発展に伴い、より広い温度で安定した出力特性を有する半導体光装置が求められている。光通信用の光源としては、比較的短距離の通信用には発光ダイオード(LED)が用いられるが、通常はレーザダイオード(LD)が用いられている。しかしながら、LD素子そのものの出力特性は周囲の温度による変化が大きく、図12に示すように高温ほど閾値電流Ithが増加し、微分効率 nが低下する。LDを光通値電流に対れてス電流を印加し、さらにパルス電流を重量でいバイアス電流を印加し、さらにパルス電流を重量でいバイアス電流を印加し、さらにパルス電流を重量でいいイアス電流を印加し、さらにパルスを発生させているが、受信素子のダイナミックレンジ等の問題から光パルスの波高値は出来るだけ一定にする必要がある。

【0003】しかしながらLDにおいては上述のごとく、その出力特性に温度依存性があるため、一般にはLDを一定の温度に保つための温度制御装置が利用されるが、この温度制御装置は高価なだけでなく、半導体光装置の大きさ及び消費電力を大きくしてしまう。また、こ

のような温度制御装置を用いない場合は、温度上昇に伴い微分効率 n が大きく低下するため、直流パイアス電流を制御すると共に、これに重畳するパルス電流の大きさにも補正を加えることにより光パルス出力の波高値を一定にしなければならないが、LDの光出力特性の温度依存性が大きいほど、変調回路の構成と制御が複雑となる。

2

【0004】このように半導体光装置はLDの温度を一 定に保つ装置や、光出力を一定に保つための複雑な入力 10 信号制御回路を必要とし、小型化及び低価格化の点から 半導体光装置そのものの温度特性の改善が求められてい る。光通信システム用のLDに対しては、例えば「Reli ability assurance practices for optoelectronic dev ices in loop applications: Bellcore, TA-TSY-00983, Is sue 1,January 1990」等にも記述されているように、一 般に-40~+85℃の温度で動作することが求められ ており、高温光出力特性の具体値としては85℃での閾 電流値50mA以下、5mW出力時の駆動電流80mA 以下、25℃から85℃の温度上昇に対する微分効率の 低下率3dB(50%)以下であることが要求されてい る。近年、伝送速度155Mb/s以下の比較的伝送速 度の低い数十km以上の長距離伝送、あるいは、伝送速 度1Gb/s等の高い伝送速度ではあるが伝送距離が1 km未満の比較的短距離伝送等の用途に使用されるFa bry-Perot共振器型のLD (以下、FP-L D) においては、この-40~+85℃の温度範囲で動 作保証された素子が、多重量子井戸 (Multiple Quantum Well;以下MQW) 活性層構造あるいは歪MQW活性層 構造の導入や、電流狭窄構造の改善により実現されてい 30

【0005】しかしながら、図13(a)の如く多重縦 モード発振しているFP-LDはその発振波長スペクト ルの広がりから長距離伝送中に信号波形が劣化し、数百 Mb/s以上の高速長距離伝送用途には使用することが できない。このため、一般には図13(b)の如く素子 中に形成された回折格子によって決定される波長におい て単一軸モード発振する分布帰還型LD (Distributed-FeedBack Laser Diode; 以下、DFB-LD) が用いら れるが、DFB-LDにおいては以下に示す離調量の温 40 度変化のために-40~+85℃広い温度範囲において 安定した光出力特性ならびに単一軸モード発振特性を実 現するのは困難であった。DFB-LDは素子中に形成 された回折格子の周期 A, 及び LD 素子を導波するレー ザ光に対する光導波層の実効屈折率neff によって決定 されるブラッグ波長入Bragg = 2 neff Aにおいて単一 軸モード発振が行われるが、この発振波長入Bragg は活 性層温度の上昇に対して約0.09nm/℃の割合で長 波長化する。

【0006】一方、LD活性層のバンド構造の温度変化 50 のために、光学利得が最大となる波長、即ち最大利得 (Gain Peak) 波長入GPにも温度依存性が存在し、活性層温度の上昇に対して3~6 nm/℃の割合で長波長化する。なお、最大利得波長入GPは素子に注入される電流の大きさによっても変化するため、本件における最大利得波長入GPは発振閾値電流 I thの 0.9 倍の電流注入時の最大利得波長を以て定義する。

【0007】ブラッグ波長入Bragg と最大利得波長入GPの差、即ち離調量 Δ λ = λ Bragg $-\lambda$ GPはDFB-LD の光出力特性ならびに高速変調特性を大きく左右し、ある一定の温度で動作させるDFB-LDを設計する際においても、極めて重要なパラメータの一つであるが、上述の如き温度変化に対する λ Bragg と λ GPのシフト量の違いから、離調量 Δ λ に温度依存性が生じ、DFB-LDの広温度範囲動作を極めて困難なものとしている。

【0008】図14は25℃(以下、単に室温とも言う)における離調量が+10nmのDFB-LDに発振 閾値電流 I thの 0.9倍の電流を印加した際の発振閾値 前スペクトルの温度変化を示した図であるが、85℃で は離調量 Δ 人が-8nmと20nm近く負にシフトして いる。また低温での離調量 Δ 人は-20℃では+18nm、-40℃では+30nmにも達しており、このような離調量の絶対値 $|\Delta$ 人|0増大は後述のようにDFB -LDがブラッグ波長において単-軸モード発振するためには大きな障害となる。

【0009】現在実用に供されているDFB-LDは、 回折格子に位相シフトを設けていない素子と位相シフト を設けた素子に大別することができるが、前者(以下、 均一回折格子DFB-LDと言う)では通常、素子の前 方端面反射率を1%以下に、後方端面反射率を70~9 0%以上にすることにより前方から射出される光量すな わち前方の微分効率を大きくしている。しかしながら、 後方端面の比較的高い端面反射率のために離調量が大き くなるとFabry-Perotモード (以下、FPモ ード)発振を十分に抑圧することができないという問題 が生じる。比較的狭い温度範囲においてのみ動作させる 場合には、このFPモード抑圧特性はほとんど問題にな らないが、前述のように離調量△入には強い温度依存性 が存在するため、広い温度範囲で十分なFPモード抑圧 比 (Fabri-Perot Mode Suppression Ration; FMSR) を確保することは極めて困難なものとなる。

【0010】例えば、前方反射率1%以下,後方反射率75%の均一回折格子DFB-LDの場合、図15に示すように低温での離調量の増大により、-20 $\mathbb C$ ($\Delta\lambda$ = +18 nm) におけるFMSRは室温における35dBから20dBまで低下し、さらに-40 $\mathbb C$ ($\Delta\lambda$ = +30 nm) では図15 (c) のようにFPモード発振がDFBモードよりも支配的になってしまう。このようなFMSRの低下は伝送特性の劣化、すなわち受信感度の劣化や、符号誤り率の増大を引き起こし、更に、FPモード発振がDFBモードよりも支配的な状況において

は、もはやDFB-LDとしての動作はなされておらず、伝送速度数百Mb/s以上、伝送距離数数+km以上という長距離高速光通信システムの光源としては使用することができない。

【0011】一方、後者、即ち回折格子に位相シフト部 を有するタイプの素子では、図16(a)に示した概念 図の如く回折格子軸方向中央部付近に位相シフト量1/ 4の位相シフト部を設けた素子 (以下 A / 4シフト D F B-LDと言う)が実用化されている。 入/4シフトD 10 FB-LDにおいては素子の両端面は反射率1%以下の 無反射コーティングを施すことによって図16(b)に 示すような回折格子によるストップバンド中央付近のブ ラッグ波長で安定した単一軸モード発振を得ることがで きる。また、両端面が無反射コーティングされているこ とからFPモードが発振しにくく、室温離調量が前述の 均一回折格子DFB-LDと同じ素子においても、-2 0°C (Δλ=+18nm) におけるFMSRは50dB 以上と室温と比べてもほとんど劣化せず、さらに-40 °C (Δλ=+30nm) においても30dB以上のFM 20 SRを維持することができる。

【0012】しかしながら、前後方端面の反射率を変えることによって前後方出力比を大きくすることができないため、高出力動作は特に高温において困難であり、これまでに例えば85℃等の高温で $\lambda/4$ シフトDFB-LDの安定動作を実現したという報告はなされていない。例えば活性層にInGaAsP歪多重量子井戸を導入することにより高温特性を改善した共振器長300 μ m,室温での離調量-10nm,量子井戸数7(量子井戸層への光閉じ込め係数2.5%)の素子においても、電流-光出力特性の温度依存性は図16(c)に示すようなものであり、室温から85℃の温度上昇による微分効率の低下率が3.5dBと大きい等、LDの無温調動作ならびに駆動回路の簡略化により半導体光装置の低価格化、小型化、低消費電力化を実現するには不十分であった。

【0013】上述のように、DFB-LDにおいてはFP-LD同様の現象である高温での利得の低下のみならず、離調量△入の変化による発振波長利得の増減やFPモード抑圧比の変化が顕著となるため、広い温度範囲で 40 安定した光出力特性ならびに高速変調特性を確保するのは極めて困難であり、これまでは山本らの「高温動作型全MOCVD成長1.3μm帯歪MQW-CBPBH-DFB-LD(1994年電子情報通信学会秋季大会予稿集,C-302)」にあるように均一回折格子DFB-LDを用いた-20~85℃における622.08Mb/s動作の報告がなされているにすぎなかった。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の LDにおいては、伝送速度数百Mb/s以上(通常62 2.08Mb/sあるいは2.48832Gb/s)、 伝送距離数十km以上(通常40km以上)という長距離高速光通信システムの光源として用いるDFB-LDには温度を一定に保つための温度制御装置が必要であり、この温度制御装置のために、半導体光装置の低価格化、小型化、低消費電力化が大幅に制限されるといる高速が生じている。その理由は、上述のごとき長距離時間、光通信システムに用いられるDFB-LDは光出力特性、発振スペクトル特性、高速変調特性に極めて設ました単一は、発振スペクトル特性、高速変調特性に極めて設ました単一を表示との温度範囲での安定した単一軸モード発振、ならびに、高温での良好な光出力特性、具体の駆動電流80mA以下、25℃から85℃の温度上昇には85℃での閾電流値50mA以下、5mW出力時の駆動電流80mA以下、25℃から85℃の温度上昇に対する微分効率の低下率3dB以下を実現するのが極めて困難であるからである。

【0015】本発明の目的は、広い温度範囲で良好な光出力特性ならびに変調特性を有し、伝送速度数百Mb/s以上(通常622.08Mb/sあるいは2.48832Gb/s)、伝送距離数十km以上(通常40km以上)の長距離高速光通信システムの光源として使用可能なレーザダイオード素子を提供することである。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明のレーザダイオード素子は、InGaAsP 歪多重量子井戸からなる活性層を有し、共振器長 $300\sim600$ μ m、かつ、室温での離調量 $-15\sim+15$ nmで、量子井戸数 $8\sim15$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $3\sim10$ %であることを特徴とする。この場合、高い歩留りで素子を製造するためには、共振器長 $400\sim500$ μ m、かつ、室温での離調量 $-10\sim+10$ nmで、量子井戸数 $10\sim12$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $5\sim8$ %であることが好ましい。

【0017】また本発明のレーザダイオード素子は、A1 G a I n A s 歪多重量子井戸からなる活性層を有し、共振器長 $250\sim600\mu$ m、かつ、室温での離調量- $20\sim+15$ n mで、量子井戸数 $5\sim15$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $2\sim10\%$ であることを特徴とする。この場合、高い歩留りで素子を製造するためには、共振器長 $300\sim500\mu$ m、且つ、室温での離調量 $-15\sim+10$ n m で、量子井戸数 $6\sim12$ 層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が $2.5\sim8\%$ であることが好ましい。

【0018】なお、本発明においては量子井戸数Nwに対して必要とされる条件と量子井戸層への光閉じ込め係数 Γw に対して必要とされる条件を併記しているが、これは両者が独立したパラメータではなくお互いに相関のある値であり、かつ素子特性に与える影響は直感的な認識が容易なNwよりもむしSNwと共に変化する Γw の方が支配的であるという認識に基づいたものである。例えば量子井戸幅60%でNw=7, $\Gamma w=6$ %の素子の

特性は量子井戸幅が40Åの素子の場合、Nw=7, Γ w=4%の素子よりもむし5Nw=10, Γ w=6%の素子の特性に近いものとなるが、これはLDの諸特性を大きく左右する光学利得の大きさが Γ wに比例するためである。

ĸ

【0019】また本発明にかかる素子の製造方法、入/4シフト回折格子の位置、活性層の層構造、量子井戸層の歪量、電流狭窄構造はどのような方法、構造、位置あるいは値であっても構わず、DFB-LDにおいて単一10 モード歩留まりや電流光出力特性の直線等に大きな影響を及ぼす(回折格子の結合係数)×(共振器長)の値は、入/4シフトDFB-LDの単一モード歩留まりを著しく悪化させない値、約2~3の範囲内であれば良い。

[0020]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。まず、本発明の第1の実施形態として、電流狭窄構造としてDC-PBH構造、活性層にInGaAsPの歪MQW(圧縮歪量0.5%,量子井戸の幅約40Å)を用いた入/4シフトDFB-LDにおいて、共振器長L,25℃での離調量△λ25℃,量子井戸数Nwをパラメータとし、その高温光出力特性、FPモード抑圧比(FMSR)、ならびに高速変調特性との相関について述べる。図1は本実施形態の素子構造の斜視図であり、同図において、n型InP基板11に歪量子井戸層12、パリア層13からなる活性層が形成され、DC-PBH電流狭窄構造14と入/4シフト回折格子15が形成される。また、裏面にはn側電極16が、表面に無反射コーティング17とp側パッド電極18が形成される。また、Lは共振器長を示す。

【0021】図2(a)はL= 450μ mの素子におい て、Δ入25℃とNw をパラメータとして、25℃から8 5℃の温度上昇に対する微分効率の低下率 Δ η 25℃を示 した図である。図中のプロット点及び誤差棒はそれぞれ 素子の平均値及び分散を示したものであり、以下素子特 性を示す図には同様の表示を行う。Nw が一定の場合、 △ 入25℃が大きい程、即ち室温でのブラッグ波長が最大 利得波長よりも長波長側にあるほどΔη25℃が小さくな るが、これは温度上昇によって△入が負にシフトした場 40 合にも、△入25℃が大きいほど高温での△入の絶対値が 小さく、ブラッグ波長において十分な光学利得を得るこ とができるためである。また、△ん25℃が一定の場合、 Nw が大きいほど $\Delta \eta 25$ $^{\circ}$ Cが小さくなるが、これはNw が大きいほど量子井戸層への光閉じ込め係数 Γ w が大き くなり、高温でも十分な光学利得が得られることと、N w が大きいほど同一注入電流においても量子井戸一層あ たりの注入キャリア密度が小さく、高温で顕著となるキ ャリアオーバーフローによる光学利得の減少を小さくす ることができるためである。

50 【0022】後述するように、-40~+85℃の温度

範囲において長距離高速伝送に十分なFMSRを確保するためには室温離調量 $\Delta \lambda 25$ $\mathbb C$ は + 15 n m以下であることが必要となり、この点を考慮すると $\Delta n85$ $\mathbb C$ ≤ 3 d Bという条件に対して十分な歩留まり、例えば 5 0 %以上の歩留まりを確保するには N w が 8 以上、あるいは Γ w が 3 %以上であることが必要となる。 N w あるいは Γ w を増加することにより、高温特性のうち $\Delta n85$ $\mathbb C$ の改善は可能であるが、 N w あるいは Γ w がある程度よりも大きくなると素子における光導波損失が増大し、閾値電流 I thの上昇、微分効率 n の低下、ならびに一定光出力時の駆動電流 I opの増加が問題となる。

【0023】図2(b)は $L=450\mu$ m, $\Delta\lambda25$ C=0nmの素子の85 Cにおける閾値電流 I th85 C及び5mW出力時の駆動電流 I op85 CNw 依存性を示したものであるが、I th85 C, I op85 Cともに Nw = 10以上での増加が顕著となり、I th85 C ≤ 50 mA, I op85 C ≤ 80 mAという条件に対して十分な歩留まり、例えば50 %以上の歩留まり確保するためには Nw が15 以下、あるいは 10 Fw が10 M以下であることが必要となる。

【0024】以上のように高温での微分効率の低下率△ **カを小さく抑え、且つ、高温での閾値電流ならびに駆動** 電流の増加を抑え、Δη85℃≦3dB, Ith85℃≦50 mA, Iop85℃≦80mAという条件に対して十分な歩 留まりとして50%以上の歩留まり確保するためには、 Nw が8以上15以下、あるいはΓw が3%以上10% 以下であることが必要であり、好ましくはNw=10~ 12, Γ w = $5\sim8$ %の範囲内であることが望ましい。 【0025】次にNw = 10, △ \ 25°C = 0 n m の素子 を例に、高温光出力特性の共振器長し依存性に関して述 べる。図3 (a) はNw = 10, △ \(\lambda\)25℃=0nmの寮 子における△n85℃のL依存性を示したものであるが、 Lが大きい、即ち共振器長が長いほど△n85℃が改善さ れる傾向にあり、 △ η85°C ≦ 3 d Bという条件に対して 50%以上の歩留まりを確保するためには300μm以 上の共振器長が必要となる。これは共振器長が長いほど 電流密度の低減により、高温での電流狭窄部分における リーク電流の低減や活性層におけるキャリアオーパーフ ローが低減され、また最大光出力も増加することを反映 したものである。しかしながら、共振器長を長くすると 光導波損失の増加と注入電流密度の増加により、やはり 閾値電流の上昇と微分効率の低下、及び一定光出力時の 駆動電流の増加が問題となる。図3 (b) に示すように Lの増加に伴うIth85℃及びIop85℃の増加は著しく、 Ith85℃≦50mA, Iop85℃≦80mAという条件に 対して十分な歩留まりを確保するためには共振器長は6 00μ m以下であることが望ましく、 500μ m以下で あることが好ましい。

【0026】以上のように高温での微分効率の低下率を小さく抑え、且つ、高温での閾値電流ならびに駆動電流の増加を抑えるためには、共振器長Lは300μm以上

 600μ m以下であることが必要であり、好ましくは $400\sim500\mu$ mの範囲以内であることが望ましい。

8

【0027】以上、高温光出力特性を確保するために必要とされる素子の設計パラメータについて述べたが、次に $-40\sim+85$ % にも及ぶ広い温度範囲において安定した単一軸モード発振を可能とするために必要となる素子パラメータについて説明する。

【0028】図4(a)はL=450μm, Nw = 10 (Γw = 6%)の素子において Δ λ 25℃をパラメータに 10 FPモード抑圧比FMSRの温度依存性を示したもので あるが、Δ λ 25℃=+10 n m の素子は低温で、Δ λ 25 ℃=-15 n m の素子は高温で、それぞれ離調量の絶対 値の増加によりFMSRが劣化している。図4(b)は -40℃ならびに+85℃におけるFMSRの Δ λ 25℃ 依存性を示したものであるが、-40~+85℃の温度 範囲で長距離高速伝送を可能とするのに十分なFMS R、例えば622Mb/s-50km伝送では30dB 以上のFMSRを確保するには、室温での Δ λ 25℃は+ 10~-15 n m の範囲内であることが必要であること 20 がわかる。

【0029】なお、離調量の絶対値の増大に伴うFMSRの劣化は量子井戸層数Nwあるいは Γ wが多いほど顕著となり、同様のFMSRを $-40\sim+85$ ℃の温度範囲で確保するための $\Delta\lambda25$ ℃の許容範囲はNw=8の素子で $+15\sim-18$ nm、Nw=12の素子で $+8\sim-12$ nm、Nw=15の素子では $+6\sim-10$ nmの範囲に制限される。このように、広い温度範囲及び $\Delta\lambda25$ ℃に対して十分なFMSRを確保するという観点において、Nwは15以下であることが望ましい。

30 【0030】以上の結果から、-40~+85℃という 広い温度範囲において伝送速度数百Mb/s以上(通常622.08Mb/sあるいは2.48832Gb/s)、伝送距離数十km以上(通常40km以上)という長距離高速光通信システムの光源として用いることができる1.3μm帯InGaAsP系λ/4シフト歪MQW-LDを実現し、高い歩留まりで安価に生産供給するためには「共振器長300~600μm、且つ、室温での離調量-15~+15nmで、量子井戸数8~15層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が3~10%40であること」が必要となる。

-11 以下までエラーフロアの無い良好な伝送特性を実現 している。

【0032】 入/4シフトDFB-LDは数Gb/s以 上の伝送速度、例えば2.48832Gb/sという高 速伝送においても、ストップバンド幅中央付近のブラッ グ波長で安定した単一軸モード発振が得られるという点 において有利である。しかしながら、このような高速伝 送に適用する素子には十分な高速応答特性が必要であ り、ここでも共振器長L、量子井戸数Nw もしくは量子 井戸層への光閉じ込め係数 Γ ν 、ならびに離調量 Δ λ が 各々素子の高速応答特性に大きな影響を及ぼし、-40 ~85℃の温度範囲で実用的に十分な光出力特性と伝送 速度数Gb/s以上の長距離伝送を実現するための値は 更に限定されたものとなる。

【0033】図6は素子の高速応答特性の目安として2 5℃において光出力5mW時の緩和振動周波数fr の共 振器長L、量子井戸数Nw、ならびに25℃における離 調量△入25℃依存性を示したものであるが、Lが小さ く、Nw あるいは \(\Gamma\) が大きく、\(\Delta\) 25℃が小さいほど 高速応答特性が向上する。また、図7は光出力5mW時 の緩和振動周波数 fr の温度依存性を示したものである が、低温領域では離調量△入が正にシフトするために高 速応答特性が低下する。この点を考慮すると、素子の高 速応答特性に与える影響が極めて大きい△ 入25℃は 0 以 下であることが望ましい。以上の結果から、-40~+ 85℃という広い温度範囲で伝送速度数Gb/s以上 (通常2.48832Gb/s), 伝送距離数十km以 . 上 (通常40km) の長距離高速伝送の光源として適用 することができる1.3μm帯InGaAsP系入/4 シフト歪MQW-LDを実現し、高い歩留まりで安価に 生産供給するためには「共振器長300~500μm、 且つ、室温での離調量-15~0nmで、量子井戸数1 0~15あるいは量子井戸層への光閉じ込め係数 Γw が 5~10%」であることが必要となる。

【0034】図8は上述の設計パラメータ範囲内におい て作製した素子の一例として、「L=450 μ m, $\Delta\lambda$ 25°C = -8 n m, Nw = 1 2 (Γw = 6.6%) $\int O \lambda$ /4シフト歪MQW-LDの電流-光出力特性の温度特 性、ならびに-40℃, +85℃における2.4883 2Gb/s-40km伝送特性の典型例を示したもので あるが、85℃においても「閾値電流42mA、5mW 出力時の駆動電流72mA,25℃からの微分効率の低 下率2.5dB」という優れた高温光出力特性と、-4 0~+85℃における符号誤り率10-11 以下までエラ ーフロアの無い良好な伝送特性を実現している。

【0035】次に、本発明の第2の実施形態として、p - InP基板上の活性層に第1の実施形態と同じくIn GaAsPの歪MQW構造を用い、電流狭窄構造として 有機金属化合物気相成長法 (以下MOVPE法) により 埋め込み成長したPBH構造を用いた場合について述べ 50 高温光出力特性を実現するための共振器長L、離調量 Δ

る。図9は本実施例にかかる「L=450 μ m, $\Delta\lambda25$ C = 0 nm, Nw = 10 ($\Gamma w = 6\%$) $\int 0\lambda/4 > 7$ ト歪MQW-LDの電流-光出力特性の温度特性を示し たものである。MOVPE法を用いる事により、第一の 実施例の如く液相成長法(以下、LPE法)でDC-P BH構造を形成した場合よりも、電流狭窄構造作製上の 制御性ならびに再現性を向上することが可能であり、ま た同図において確認できるように、室温付近あるいはそ れ以下の温度における閾電流値の低減効果が顕著であ 10 る。しかしながら85℃における閾電流値、あるいはス ロープ効率の低下率、5mW光出力時の駆動電流値は第 1の実施形態において示したDC-PBH構造の素子と 同程度である。また、電流狭窄構造あるいはその成長方 法の違いによってFMSRならびに高速変調特性が大き く変化することはなく、共振器長、室温離調量、ならび に量子井戸数(あるいは光閉じ込め係数)が素子特性に 与える影響が最も支配的である。

10

【0036】以上の理由から電流狭窄構造としてMOV PE法により埋め込み成長したPBH構造、あるいは他 の電流狭窄構造やリッジ導波路型のLDにおいても、活 性層にInGaAsPからなる歪MQWを用いた場合に は、-40~+85℃という広い温度範囲において伝送 速度数百Mb/s以上(通常622.08Mb/sある いは2.48832Gb/s)、伝送距離数十km以上 (通常40km以上)という長距離高速光通信システム の光源として用いることができる1.3 μm帯 In Ga AsP系Δ入シフト歪MQW-LDを実現し、高い歩留 まりで安価に生産供給するためには「共振器長300~ 600 μm、且つ、室温での離調量-15~+15 nm で、量子井戸数8~15層もしくは量子井戸層への光閉 じ込め係数が3~10%であること」が必要となる。

【0037】次に本発明の第3の実施形態として、活性 層にAlGaInAsの歪MQWを用いたリッジ導波路 型入/4シフトDFB-LDの場合について述べる。本 実施例において採用したA1GaInAs活性層は、図 10に歪み量子井戸層12、バリア層14における量子 井戸層の伝導帯ポテンシャル P 1, P 2、バリア層の伝 導帯ポテンシャルP3, P4、伝導帯のバンド不連続量 ΔEc、価電子帯のバンド不連続量ΔEνを示すよう

40 に、ヘテロ接合界面における伝導帯のバンド不連続量△ Ec が同じバンドギャップ差のInGaAsPのヘテロ 界面よりも大きくなるため、正孔に比べて有効質量の小 さな電子の量子井戸層への閉じ込めが強く、高温でのキ ャリアオーバーフローが小さい。この結果、InGaA SP系のLDよりも高温での光出力特性の劣化が少ない LDを得ることができる。

【0038】したがって、本発明の第1の実施形態及び 第2の実施形態で述べた、活性層にInGaAsPの歪 MQWを用いた入/4シフトDFB-LDよりも所要の

要とされる制限は緩和され、-40~+85℃において

伝送速度数百Mb/s以上(通常622.08Mb/s

あるいは2.48832Gb/s)、伝送距離数十km

以上(通常40km以上)という長距離高速光通信シス

テムの光源として用いることが可能な半導体レーザ装置

つ、室温での離調量-20~+15 nmで、量子井戸数

4~15層もしくは量子井戸層への光閉じ込め係数が2

2. 48832Gb/s)、伝送距離数十km以上(通

常40 km以上)という長距離高速光通信システムの光

源として用いることができる半導体レーザ装置を高い歩

留まりで安価に生産供給するための値は「共振器長25

0~500μm、且つ、室温での離調量-20~+0n

mで、量子井戸数5~15層もしくは量子井戸層への光

【0039】図11は活性層にA1GaInAs歪MQ

Wを用いた「L=300 μ m, $\Delta \lambda 25$ °C=-6nm, N

 $w = 10 (\Gamma w = 5\%) \rfloor \mathcal{O}\lambda/4 \mathcal{D} + DFB - LD$

の電流-光出力特性の温度特性の典型例を示したもので

あるが、85℃においても「閾値電流35mA, 5mW

出力時の駆動電流60mA,25℃からの微分率低下率

1.2 d B」という優れた高温光出力特性が得られてお

閉じ込め係数が3~10%」となる。

~10%」となり、伝送速度数Gb/s以上の(通常

を得るための値は「共振器長250~600 µm、且

【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施形態のレーザダイオード素子の斜視図である。
【図2】第1の実施形態におけるスローブ効率の低下率

12

【図2】第1の実施形態におけるスロープ効率の低下率 及び室温離調量と、閾電流値及び光出力時駆動電流のそ れぞれ量子井戸数依存性を示す図である。

【図3】第1の実施形態におけるスローブ効率の低下率 と、閾電流値及び光出力時駆動電流のそれぞれ共振器長 依存性を示す図である。

10 【図4】第1の実施形態におけるFPモード抑圧比の温度特性と、FMSRの室温離調量依存性を示す図である。

【図5】第1の実施形態における電流-光出力特性の温度特性及び伝送特性の典型例を示す図である。

【図6】第1の実施形態における緩和振動周波数の共振器長、量子井戸数、室温離調量依存性を示す図である。 【図7】第1の実施形態における緩和振動周波数の温度 依存性を示す図である。

【図8】第1の実施形態における電流-光出力特性の温 20 度特性、伝送特性の典型例を示す図である。

【図9】第2の実施形態における電流-光出力特性の温度特性の典型例を示す図である。

【図10】InGaAsP系量子井戸とAlGaInA s系量子井戸におけるバンド端不連続量の違いを示す図 である。

【図11】第3の実施形態における電流-光出力特性の 温度特性の典型例を示す図である。

【図12】レーザダイオードの電流-光出力特性の温度 依存性を示す図である。

30 【図13】 FP-LDの縦多モード発振と、DFB-L Dの単一縦モード発振を示す図である。

【図14】DFB-LDの発振閾値前スペクトルの温度 変化を示す図である。

【図15】均一回折格子DFB-LDにおける低温での FPモード抑圧特性の劣化を示す図である。

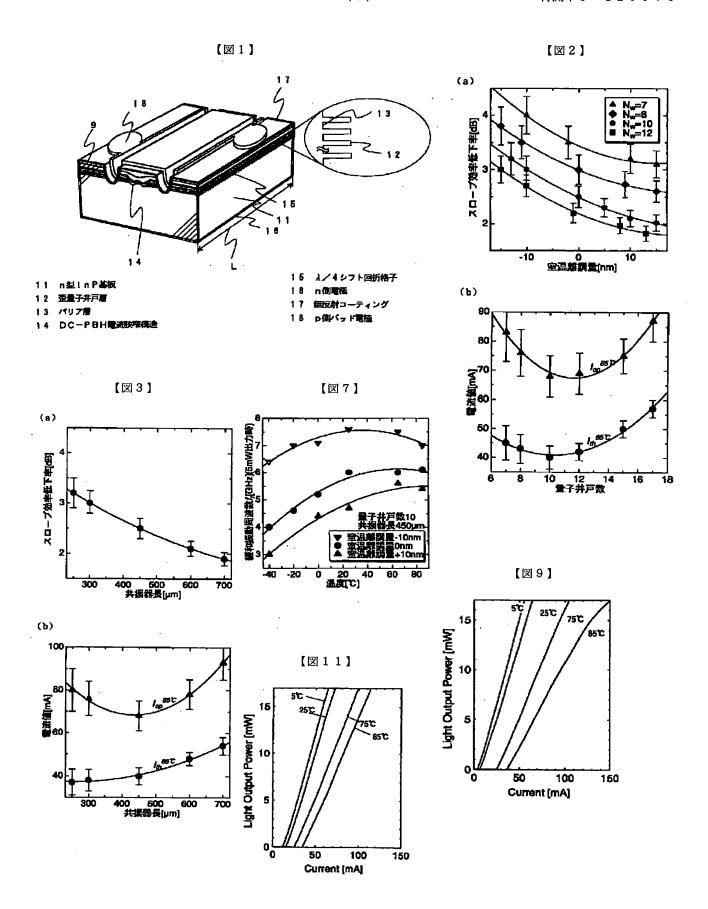
り、-40~+85℃という広い温度範囲において符号 誤り率10⁻¹¹ 以下までエラーフロアの無い良好な2. 48832Gb/s-40km伝送を実現している。 【0040】 【発明の効果】以上説明したように本発明は、優れた高 温動作特性と広温度範囲での優れたスペクトル特性、具 体的には85℃での閾電流値50mA以下,25℃から 85℃の温度上昇に帯する微分効率の低下率3dB以 下,85℃における5mW出力時の駆動電流80mA以 下、-40~+85℃の温度範囲における30dB以上 のFPモード切圧比を有する3/4シフトDFB-ID

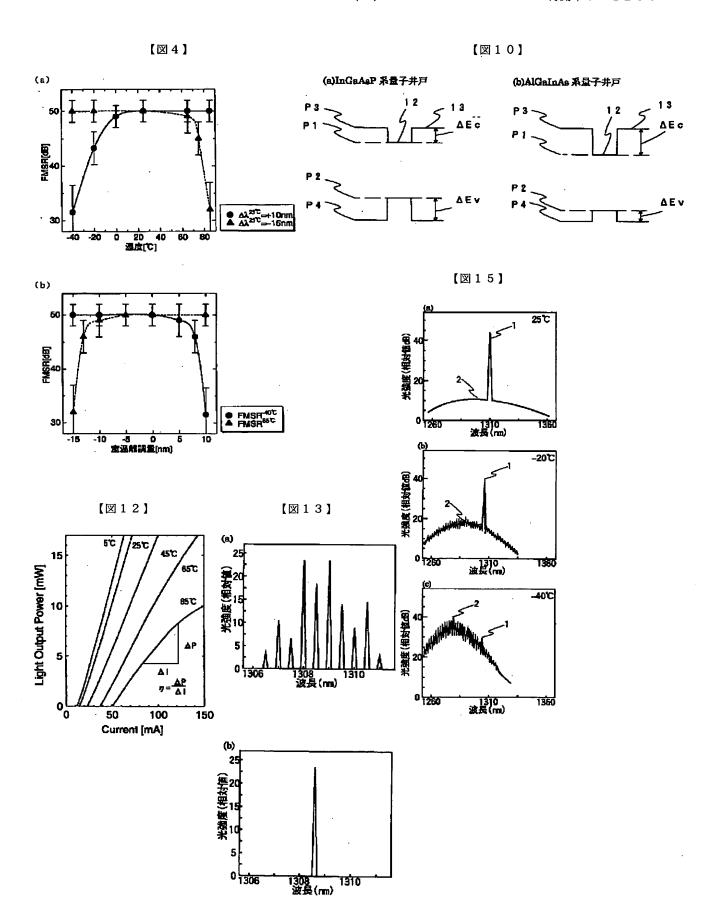
下,85℃における5mW出力時の駆動電流80mA以 下、-40~+85℃の温度範囲における30dB以上 のFPモード抑圧比を有する入/4シフトDFB-LD を高い歩留まりで作製することができるということであ る。これにより、-40~+85℃という広い温度範囲 において、伝送速度数百Mb/s以上(通常622.0 8Mb/sあるいは2.48832Gb/s)、伝送距 離数十km以上(通常40km以上)という長距離高速 光通信システムの光源として使用することができる光半 導体装置を安価に大量に供給することができる。その理 由は、素子パラメータが本発明において見出した範囲内 にあるときにのみ、上述の如く広い温度範囲で良好な特 性を有するLDを高い歩留まりで作製する事が可能であ り、これにより、光半導体装置においてLDを一定の温 度に保つための温度制御装置を不要とし、半導体光装置 の大きさ、消費電力、ならびに製造コストを低減するこ

とができるからである。

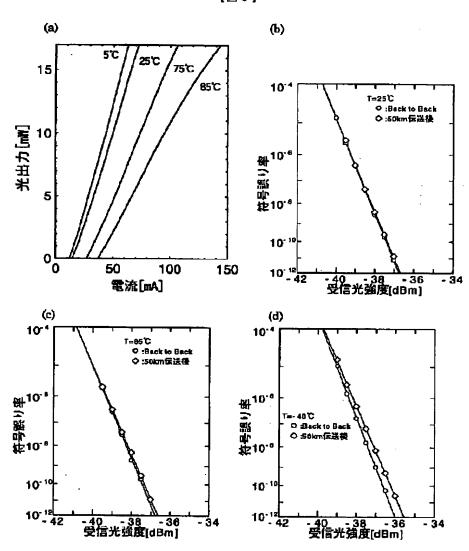
【符号の説明】

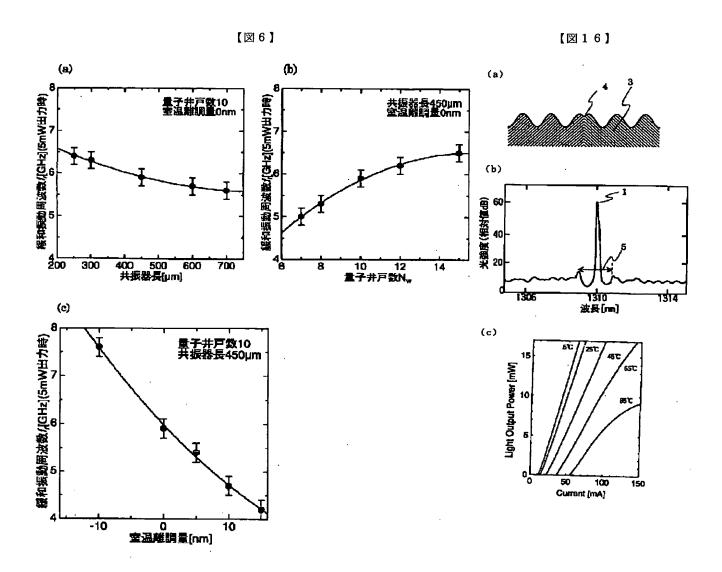
- 11 n型InP基板
- 12 歪み量子井戸層
- 13 バリア層
- 14 DC-PBH電流狭窄構造
- 15 入/4シフト回折格子
- 16 n側電極
- 17 無反射コーティング膜
- 18 p側パッド電極



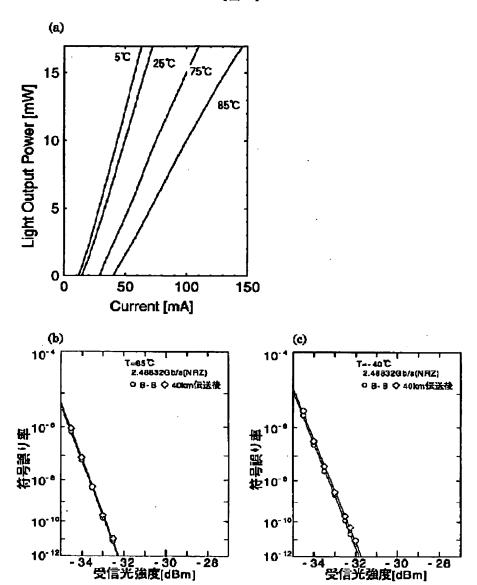


【図5】

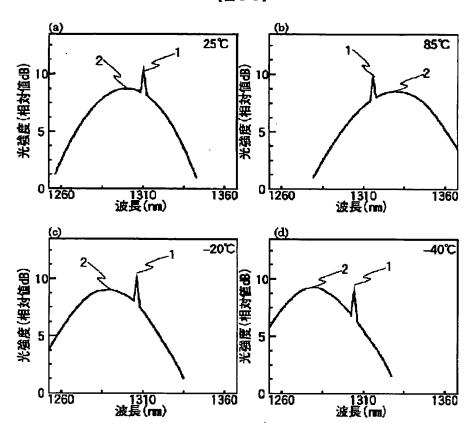




【図8】



【図14】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.